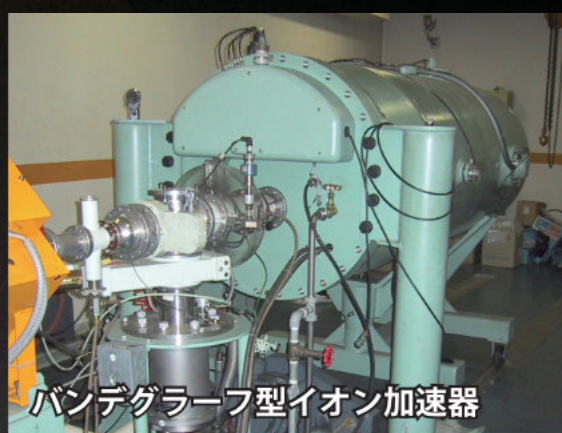




RBSビームライン



タンデム型高エネルギーイオン注入装置



ハンデグラフ型イオン加速器

第45回 法政大学

イオンビーム工学研究所シンポジウム

THE 45th SYMPOSIUM ON MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
RESEARCH CENTER OF ION BEAM TECHNOLOGY, HOSEI UNIVERSITY

日時 2026年12月9日(水)

会場 法政大学小金井キャンパス

招待講演：現地及びオンライン

一般講演(ポスター)：現地

(JR中央線東小金井駅下車徒歩12分)

詳細 <https://www.hosei.ac.jp/ionbeam/katsudo/>



● 招待講演 ●

「AIが学習できる形への物理化学知識の表現と計測データ解析」
青柳 里果 成蹊大学教授

「凹面鏡を有するGaN系VCSELおよび高密度アレイ光源の進展」
林 賢太郎 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

● 一般講演募集 ●

- 生体微量元素分析技術 ●ナノテクノロジー材料の創製 ●次世代エレクトロニクス材料
- 新材料のプラズマプロセス ●分析技術

など、イオンビーム技術と関連材料技術について募集します。

予稿締切 2026年11月6日(金)

● 参加費 ●

無料(予稿集は当日現地に配布します。Proceedings 冊子は講演者及び希望者に後日郵送します。)

● 主催・問い合わせ先 ●

法政大学イオンビーム工学研究所
〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2
TEL 042-387-6094, FAX 042-387-6095
E-Mail ion-sympo@ml.hosei.ac.jp

● 協賛 ●

日本物理学会、応用物理学会、日本アイソトープ協会



イオンビーム工学研究所